

## 奖励信息

奖励名称	中国发明专利：一种制备氧化物陶瓷涂层的阴极微弧电沉积方法
完成人	何业东；杨晓战；王德仁
完成单位	University of Science and Technology Beijing
推荐单位	
授奖机构	
授奖日期	2004年 2月 11日
奖励种类	
奖励等级	
奖励编号	ZL 01118541.4
相关项目	<a href="#">阴极微弧电沉积氧化锆-氧化钇陶瓷涂层的研究</a>